

ISC 150T

ION SPUTTER COATER

离子溅射仪（高真空版）

The pumping station of turbo pump and diaphragm pump produce a clean vacuum in the $10E-3$ Pa range, typically less than 5 minutes. Specially suitable for the metal coating of FE-SEM specimens. Sputtering metal target by a magnetron source, much lower heat and low plasma damage to the substrate sample. We offer touch panel control unit and the way "Plug and Play".

采用无油隔膜泵和分子泵组产生一个洁净的 10^{-3} Pa的真空压强，通常抽真空时间小于5分钟。采用高品质恒功率磁控溅射电源，确保恒定镀膜沉积速率。磁控阴极的使用也有效减少等离子体对样品的热影响和离子轰击损伤。特别适用于追求高分辨率场发射FE-SEM扫描电镜样品的喷金、铂等以及其他金属镀膜用途。触摸屏自动控制，即插即用。



Oil free!
Clean!
无油泵组！洁净！

Higher vacuum!
Better coating!
更高真空度！
更佳镀膜质量！

Plug and Play!
即插即用！

SuPro Instruments LTD

速普仪器

Nanshan ,

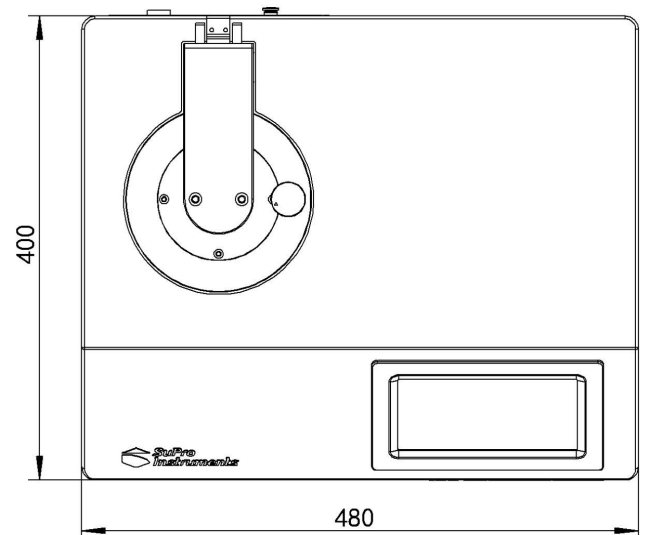
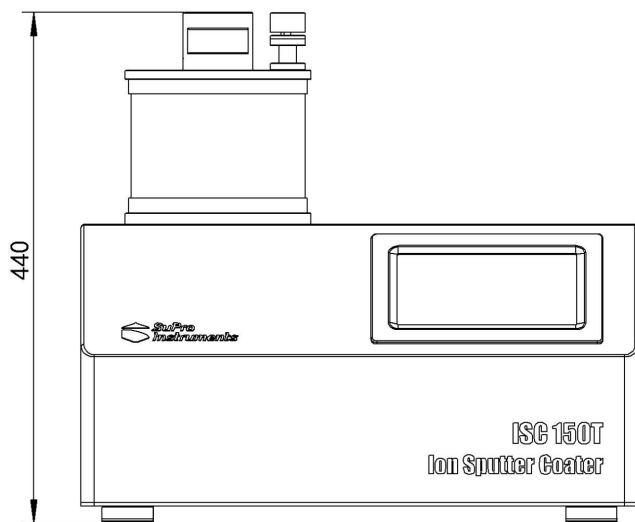
Shenzhen, China

[Http://www.suproinst.com](http://www.suproinst.com)

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

技术规格	参数
真空泵组	无油干泵+分子泵组
泵组抽速	>0.3 m ³ /h隔膜泵+25 L/S 分子泵
极限真空	<10E-3 Pa
工作气压	0.5-2 Pa
抽空时间	<5 Min
真空测量	测量范围大气压到10E-3 Pa，进口品牌皮拉尼真空计
气体控制	MFC气体质量流量控制器（50 SCCM Ar）
腔室尺寸	~Ø 150 *110 mm 耐热玻璃
磁控靶源	靶材尺寸 Ø 50 *0.1-3 mm（建议厚度>0.2 mm） / 带手动挡板 可溅射贵金属Au/Pt等，也可溅射Cr、Ag等常规金属（通Ar气）
溅射电源	恒功率磁控DC溅射电源 Max. 30W，Max. 100 mA
溅射时间	可程序设定
操作方式	触摸屏控制
重量尺寸	~30 Kg / 480 mm宽*400 mm深*440 mm高
输入电源	110-220V AC，50/60Hz 接地三脚插头
输入功耗	<500 W
冷却方式	风冷
质量保证	一年免费/终身维护
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知，如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司
 地址：深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009
 电话：0755-26642901 传真：0755-26419205
 邮件：sales@suproinst.com

深圳市速普仪器有限公司（北京办事处）
 地址：北京市海淀区太平路甲40号E座
 电话：010-63839091 传真：010-63839091
 邮件：zkchang@suproinst.com